



試験所 認定証

認定番号 RTL05240

機 関 名 称 : 株式会社東レリサーチセンター
表面科学研究部表面科学第1研究室

所 在 地 : 滋賀県大津市園山三丁目2番11号

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに試験所として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)

認 定 範 囲 : 化学試験 (附属書による。)

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2028 年 12 月 31 日

初回認定日 2024 年 12 月 10 日

公益財団法人
日本適合性認定協会

理事長

三木幸信

三木 幸信

管理番号 : RTL05240-20241210



認定番号

RTL05240

認定証 附属書

(1/1頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社東レリサーチセンター 表面科学研究部表面科学第1研究室
機関所在地	滋賀県大津市園山三丁目2番11号

1) 試験を実施する事業所

事業所名称	株式会社東レリサーチセンター 表面科学研究部表面科学第1研究室	
同 所在地	〒	520-8567
	住所	滋賀県大津市園山三丁目2番11号
恒久的施設で行う試験か、 現地試験かの別	☒ 恒久的施設で行う試験 ☐ 現地試験	

認定範囲

分野	M26 化学試験
分類コード	M26.A6
分類名称	電子製品、関連製品： シリコンウェハ

技術分類コード及び名称	試験対象項目	試験規格／標準作業手順書
B3.7 質量分析Ⅱ：SIMS	ホウ素（B）	試験規格： ・ISO 17560:2014（JIS K 0164:2023）：表面化学分析 ー二次イオン質量分析法ー シリコン内のボロンの深さ方向分布測定方法

【認定証に係る注記】

- この認定は、上記規格に規定されたラボラトリ活動を対象とするものであり、規格に含まれるその他の活動、例えばリスクマネジメント、リスクアセスメントの実施等はラボラトリの認定された能力の範囲には含まない。
- 年号及び/又は版番号の表記がない場合、最新規格の発行後半年以内に最新版に対応した試験・校正・サンプリングを実施する。
- FCC 向け EMC 試験所のみ
本認定は、試験対象品目が FCC 規制による承認を受けたことを意味するものではない。
FCC が承認した試験所の一覧は FCC ウェブサイト(<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/>) を参照のこと。

公益財団法人
日本適合性認定協会